# 原位晶体生长及化学反应的湿环境扫描电子显微分析

吉 元,张隐奇,卫 斌,王 丽

(北京工业大学 固体微结构与性能研究所,北京 100124)

**摘 要:**采用环境扫描电镜(ESEM)及微操纵/微注入系统(MMI/MIS),动态观察 NaCl 晶体的原位溶解和结晶 过程以及 BiVO4 晶体的原位反应.实测 MMI 系统的针尖在线性进退(Z<sup>-</sup>轴)、水平(X<sup>-</sup>轴)转动和垂直(Y<sup>-</sup>轴) 转动 3 个方向的位移精度分别达到 5、5 和 0.5 nm. MIS 系统的液滴尺寸为 200~300 μm. 通过改变样品室压力 (420~850 Pa)和样品温度(-1~50 ℃),控制水的蒸发和凝结状态,研究水湿环境对晶体的溶解、生长及生长速 率的影响.采用 2 个 MMI/MIS 系统,通过液体微注入方式,在 700 Pa 和 4 ℃下分别注入 NH4VO3 和Bi(NO3)3 液滴,得到原位反应产物 BiVO4 八面体.

**关键词:**环境扫描电镜(ESEM);动态和原位;微注入;加湿;BiVO<sub>4</sub>晶体 **中图分类号:**TN 16;TB 79 **文献标志码:**A **文章编号:** 0254-0037(2009)11-1548-06

环境扫描电镜(environmental scanning electron microscope,简称 ESEM)不需要对绝缘样品进行表面 导电处理、对生物样品进行冷冻和干燥处理,就可以直接观察绝缘、含水、含油、放气等样品,获得材料的真 实微观形貌和结构特征<sup>[1]</sup>. ESEM 的基本工作原理是:将水蒸汽、空气或其他辅助性气体注入 ESEM 样品 室内,利用气体分子与入射电子和信号电子碰撞产生的大量正离子,中和非导电样品在电子束辐照下表面 积累的负电荷,以此消除荷电效应.

ESEM 电磁透镜系统中的压差光阑和分级泵真空系统,可使电子枪始终保持在高真空环境中,而样品室的压力可在 13~2 600 Pa 范围内调整.

ESEM 通过调整样品室的压力、气体、温度、湿度等环境参数,提供了一个可变的环境条件,从而实现 对材料的原位和动态观察.此外,在ESEM上可配置多种附件,如Peltier 冷台、加热台、拉伸台,以及近些 年研发的微操纵/微注入系统等,从而进一步扩大了 ESEM 的功能,使 ESEM 成为一个小型微观实验室, 实现原位观测<sup>[2-4]</sup>和记录材料生长<sup>[5]</sup>、反应<sup>[6-7]</sup>、溶解<sup>[7]</sup>、结晶<sup>[8]</sup>、吸附<sup>[9]</sup>、加湿、脱水<sup>[7]</sup>、升华、腐蚀<sup>[10-11]</sup>及 刻蚀、相变、形变、断裂<sup>[12]</sup>等动态过程,研究相关的物理变化和化学反应机理以及材料与环境的相互 作用.

作者采用 ESEM、微操纵/微注入系统及 Peltier 冷台,分析了环境压力、温度和湿度对晶体生长的影响.观察了 NaCl 晶体在不同环境条件下的溶解一结晶过程及晶体的生长速率,并利用 2 个液体微注入系统,实现 BiVO4 晶体的原位反应.

#### 1 实验

采用 FEI 公司 Quanta 200 型环境扫描电镜(ESEM)·实验用加速电压 30 kV,入射电流 0.142 nA(束 斑尺寸 4),真空度  $300 \sim 850 \text{ Pa}$ ,工作距离  $9 \sim 15 \text{ mm}$ ,扫描速率 30 s/w,采用气体放大二次电子探头 (GSED)成像·样品室内气体为水蒸汽·采用 Peltier 冷台控制温度,温度范围 $-5\sim60 \text{ °C}$ .

Kleindiek 公司的微操纵/微注入(MMI/MIS)系统配置在 ESEM 上·MMI 由压电陶瓷控制,具有纳 米级的位移精度.实测 MMI 在进退、水平转动和垂直转动<sup>3</sup>个方向分别具有<sup>5</sup>、<sup>5</sup>和<sup>0.5</sup> nm 的步进.

收稿日期: 2008-12-26.

基金项目:国家自然科学基金项目资助(60171024);北京市教委基金项目资助(KN200610005030).

作者简介: 吉 元(1949-), 女, 内蒙古海拉尔市人, 教授.

MMI/MIS 可在 77 K 至高温、低真空至超高真空压力范围工作·图 1(a)为 MIS 在 ESEM 样品室内的装配 图,图 1(b)为 MIS 的微注射器组件,包括:注射针头(约 100 µm 内径)、微动阀和导线、支撑架及液体导管· MIS 系统靠样品室内、外的压力差及 1 个 ms 级的微动阀控制液滴的注入量·液体由样品室外的注射器通 过导管、微阀和针头注入到样品表面·调整微阀的开启时间(ms),即调节微阀的脉冲宽度(1~10 档),可 控制液体注入剂量,实现由小到大、由间断到连续的注入·由于 MIS 集成在 MMI 上,因此具有纳米级的 位移精度,可实现液滴的精确定位注射·MIS 最小注入量为 pL,最小液滴尺寸约为几百 µm,可实现液体 的微量和稳定滴定,并可微量调控样品局域的湿度,为研究材料微区变化、晶体生长及原位化学反应提供 了保障条件·



(a) MMI/MIS 系统



(b) 微操纵仪

图 1 ESEM 中的 MMI/MIS 系统 Fig.1 The the MMI/MIS system in an ESEM

实验用分析纯 NaCl 晶体, NaCl 溶液质量浓度为  $20 \text{ kg/m}^3$ (饱和溶液质量浓度为  $36 \text{ kg/m}^3$ ), 原位反应 生成的 BiVO4 晶体由 15.7 g/L 的钒酸氨(NH4VO3)和 3.56 g/L 的硝酸铋(Bi(NO3)3)的水溶液合成.

### 2 实验结果与讨论

#### 2.1 ESEM 环境条件对液体微注入的影响

实验测试了环境扫描电镜(ESEM)中微操纵/微注入(MMI/MIS)系统的性能,包括液滴尺寸、液体注入剂量,液滴影响范围及注入压力.

H<sub>2</sub>O、NaCl、NH<sub>4</sub>VO<sub>3</sub>和Bi(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>的水溶液在ESEM不同环境条件下的液滴注入尺寸由注射针尖的 内径决定,基本不受ESEM的环境参数和液体种类的影响.当样品室压力在 300~850 Pa、样品温度在 0 ~20 ℃、RH( φ)在 4%~86%变化时,液滴尺寸均为 200~300 μm.注入 H<sub>2</sub>O、NaCl、NH<sub>4</sub>VO<sub>3</sub>和Bi(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> 的水溶液,或改变液体质量浓度也未对注入的液滴尺寸产生明显的影响.

图 2 为液滴尺寸及液滴影响范围的二次电子(SE)像.液滴尺寸为 200~300 µm,见图 2(a).1 滴液滴 的影响区域约为 300 µm,见图 2(b).2 滴液滴同时注入的影响区域约为 500 µm,见图 2(c).表明2 滴液滴 可在滴到样品表面之前混合,为原位化学反应提供了十分有利的条件.降低样品室内的压力和液体的质



(a)1 滴液滴



(b)1 滴液滴影响区域



(c)2 滴液滴及影响

图 2 液滴尺寸及影响区域 Fig.<sup>2</sup> The size and influence range of droplets 量浓度可提高注入速率和注入剂量.液滴注入的临 界压力约为 800 Pa,微动阀的临界脉冲宽度为 1.5, 即当压力高于 800 Pa,脉冲宽度小于 1.5 时,水滴难 以滴出.

图 <sup>3</sup> 为水的三相图,表示水的气一液一固状态与 温度和压力的关系.当水达到饱和蒸气压时,相对湿 度  $RH(\varphi)$ 为 100%,水蒸汽全部凝结.  $\varphi$  由样品室压 力(P)和水的饱和蒸汽压( $P_s$ )确定.

$$\varphi = \frac{P}{P_{\rm s}} \times 100\% \tag{1}$$





#### 2.2 NaCl 晶体生长的水湿环境动态观测

在 ESEM 中,调节样品室压力和样品温度,控制环境相对湿度  $\varphi$ ,对晶体生长过程进行动态观测.图 4 为原位观察 NaCl 在改变压力和温度时的一个溶解一结晶过程.在 580 Pa 室温下, NaCl 的二次电子 (SE)像见图 4(a),此时  $\varphi=25\%$ .将压力增至 620 Pa,温度降至 4 °C, $\varphi=76\%$ 时,大量水蒸汽凝结在 NaCl 表面使其溶解,见图 4(b).图 4(c)为温度保持在 4 °C,压力降至 540 Pa, $\varphi=66\%$ ,NaCl 溶液呈过饱和状态,晶体以 7.3  $\mu$ m/s 的速率长大至 117  $\mu$ m.由于晶体生长速率较慢,得到较规则的立方晶体.此时晶体 周围还存在少量溶液,以 0.38  $\mu$ m/s 的速率继续缓慢长大至 157  $\mu$ m,20 s 后停止生长,见图 4(d).由此看 出,采用 ESEM 可通过调节压力、温度和湿度,给溶液法生长的晶体提供合适的液相(凝结)和气相(蒸发) 比,给结晶和生长提供合适的过饱和度.如将液体控制在亚稳态过饱和区,使溶液保持较小的过饱和度,即可抑制晶体形核,形成单晶体<sup>[13]</sup>.







图 5 为 1 个约 150  $\mu$ m 的 NaCl 颗粒在 420~850 Pa、-1~50 °C时的原位溶解一生长过程中得到的溶 解一结晶曲线.由此可知:提高 ESEM 样品室压力或 降低样品温度,均可使环境的相对湿度增加,使 NaCl 完全溶解;反之使其结晶.NaCl 溶解时的 9 值(76% ~77%)大于结晶时的 9 值(72%~75%),即溶解的 固一液转变温度低于结晶的固一液转变温度,使溶液 呈现过饱和状态,驱动晶体生长.此外,盐类溶解需 要吸热,使得相同压力下的溶解温度低于结晶温度.





图 6 为在配合使用液体微注入的条件下,观察 1 个 NaCl 晶粒在压力不变、改变温度条件下的溶解— 结晶过程. 压力为 550 Pa 室温下,1 个晶粒的形貌见图 6(a). 降低温度至 1 ℃,  $\varphi$ =84%, NaCl 充分溶解, 见图 6(b). 提高温度至 3.1 ℃,  $\varphi$ =72%, 溶液呈过饱和状态, 晶粒逐渐长大, 见图 6(c). 继续保持温度不 变, 经过约 20 min 后, 晶粒以 0.07  $\mu$ m/s 的速率继续长大至 240  $\mu$ m, 见图 6(d). 然后, 向 NaCl 晶粒注入质 量浓度为  $20 \text{ kg/m}^3$ 的 NaCl 溶液. 注入 1 滴后, 晶粒继续规则长大至  $268 \mu_m$ , 见图 6(e). 再注入 1 滴后, 晶粒进一步长大至  $334 \mu_m$ , 见图 6(f). 由此可见, 采用液体微注入可稳定连续地供给晶体生长所需的溶液, 并减小注入液体的扰动.



图 6 NaCl 晶粒的溶解一结晶及微注入过程

Fig. 6 A dissolving-crystallizing period with a micro-injector of a grain of NaCl; at room temperature

NaCl 晶体的生长速率与水湿环境密切相关:随环境压力和相对湿度的降低而增加;随样品温度的升高而增加.当压力由 540 Pa 降低到 480 Pa,相对湿度由 66%降低到 45%~50%,温度由 4℃增加到 8℃时,晶体生长速率由 2.4 µm/s 增加到 4 µm/s,见图 7.当温度不变时,随着压力降低,湿度减小,使溶液过饱和度增高,晶体生长速率增加.当压力不变时,随温度升高,水的饱和蒸气压增加,湿度减小,使溶液的 过饱和度增高,晶体生长速率增加.

#### 2.3 BiVO4 晶体的原位化学反应

BiVO4 由 NH4VO3 和 Bi(NO3)3 反应生成,化学式为

 $NH_4VO_3 + Bi(NO_3)_3 \longrightarrow BiVO_4$ 

 $NH_4VO_3$ 和 Bi(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>水溶液的浓度比例为 1:1. 图 8 为 ESEM 观察到的在室温和大气压条件下反 应生成的 BiVO<sub>4</sub> 的 SE 像. BiVO<sub>4</sub> 多呈八面体.

在ESEM中,采用2个MMI/MIS系统,得到由NH4VO3和Bi(NO3)3溶液原位反应生成的BiVO4晶



- 图 7 NaCl 晶体的生长速率与压力和温度的关系
  - Fig. 7 The growth rate of the NaCl crystal vspressures and temperatures



- 图 8 在室温和大气压下生成的 BiVO4 晶体的 SE 像
- Fig. 8 The SE image of BiVO<sub>4</sub> crystal made in atmosphere pressure and room temperature

(2)

体.图 9(a)为在 4 ℃和 700 Pa 条件下,2 个 MIS 注射器分别同时注入 NH4VO3 和 Bi(NO3)3 溶液各 2 滴 后,原位反应生成的 BiVO<sub>4</sub>,见图 9(b).图 9(c)为 BiVO<sub>4</sub> 晶体的 SE 放大像.原位反应得到 BiVO<sub>4</sub> 晶体与 室温和大气压下(图 8)得到的晶形相似,由于 BiVO4 晶体不溶于水,对水湿环境不敏感,当改变 ESEM 的 压力和样品温度时,不能发生如 NaCl 晶体的溶解和再次结晶过程.



(a) 2 个注入器分别注入溶液



图 9 在 ESEM 中原位反应生成的 BiVO<sub>4</sub> Fig. 9 in-situ reactive product of the BiVO4 in ESEM

#### 3 结束语

采用环境条件(压力、温度和湿度)可变的 ESEM,配合具有纳米级位移精度的微操纵/微注入(MMI/ MIS)系统,是动态研究晶体溶解、结晶、生长及合成的有效工具.MMI/MIS 系统的液滴注入尺寸为 200 ~300 µm,液滴的影响范围与液滴尺寸相当.液滴注入的临界压力约为 800 Pa.改变样品室压力(450~ 650 Pa)、样品温度(0.5~6.0 ℃)和环境相对湿度(72%~77%),观察 NaCl 晶体的溶解和生长过程.通过 调节压力、温度和湿度,控制水的蒸发和凝结状态,为晶体的结晶和生长提供了合适的过饱和度. NaCl 晶 体的生长速率与水湿环境密切相关,随环境压力降低、样品温度升高而增加. 在温度由 4 ℃升高到 8 ℃、 压力由 540 Pa 降低到 480 Pa 时, NaCl 晶体的生长速率由 2.4 µm/s 提高到 4 µm/s. 采用液体微注入方式, 在 700 Pa 和 4 ℃下,分别同时注入 NH4VO3 和 Bi(NO3)3 液滴,原位反应生成 BiVO4 八面体.

**致谢**:感谢国家自然科学基金项目(60171024)及北京市教委基金项目(KN200610005030)的资助.感 谢夏定国教授及杨涛博士在提供样品方面给予的帮助.

#### 参考文献:

- [1] TOTH M, THIEL B L, DONALD A M. Interpretation of secondary electron images obtained using a low vacuum SEM[J]. Ultramicroscopy, 2003, 94, 71-87.
- [2] P. A ROSSI M, GOGOTSI Y. Environmental SEM studies of nanofiber-liquid interactions [J]. Asia/Pacific Microscopy and Analysis, 2004, 18(4): 13-15.
- [3] 吉元,王丽,卫斌,等.扫描电镜中纳米材料的原位操纵和动态观察[J].北京工业大学学报,2008,34(4):429-433. JI Yuan, WANG Li, WEI Bin, et al. In-situ micromanipulation and dynamic observation of nano-sized materials by using a scanning electron microscope-micromanipulator system [J]. Beijing University of Technology, 2008, 34(4): 429-433. (in Chinese)
- [4] 权雪玲, 吉元, 张虹, 等. 环境敏感水凝胶的环境扫描电镜观察[J]. 真空科学与技术学报, 2005, 25(3): 225-232. QUAN Xue-Ling, JI Yuan, ZHANG Hong, et al. Observation of thermo-sensitive hydrogels by ESEM[J]. Chinese Journal of Vacuum Science and Technology, 2005, 25(3): 225-232. (in Chinese)
- [5] 邵曼君.环境扫描电镜原位研究纯 Fe 表面氧化过程[J].金属学报, 2000, 36(3): 230-234. (in Chinese) SHAO Man-jun. In-situ study of oxidation on iron surface with esem[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2000, 36(3): 230-234. (in Chinese)
- [6] KITCHING S, DONALD A M. Beam damage of polypropylene in the environmental scanning electron microscope; an FTIR

study[J]. Journal of Microscopy, 1998, 190(3): 357-365.

- [7] CALLOW J A, OSBORNE M P, CALLOW M E, et al. Use of environmental scanning electron microscopy to image the spore adhesive of the marine alga Enteromorpha in its natural hydrated state[J]. Colloids and Surfaces B, 2003, 27: 315-321.
- [8] 张隐奇,王丽,卫斌,等. ESEM 在微注入条件下的湿环境研究及原位实验[J]. 电子显微学报, 2008, 27(1): 38-42. ZHANG Yin-qi, WANG Li, WEI Bin, et al. Preliminary of wet environments and in-situ experiments in ESEM with microinjector conditions[J]. Journal of Chinese Electron Microscopy Society, 2008, 27(1): 38-42. (in Chinese)
- [9] ZHENG Y M, HAN D, ZHAI J, et al. In situ investigation on dynamic suspending of microdroplet on lotus leaf and gradient pf wettable micro- and nanostructure from water[J]. Applied Physics Letters, 2008, 92: 084106.
- [10] ATRENS A, WANG Z F. ESEM observations of SCC initiation for 4340 high strength steel in distilled water[J]. Journal of Materials Science, 1998, 33: 405-415.
- [11] 徐福建, 邵曼君. 纤维素酶固体发酵环境扫描电镜观察[J]. 电子显微学报, 2002, 21(1): 25-29.
  XU Fu-jian, SHAO Man-jun. Observation of solid-sate fermentation process of cellulase by environmental scanning electron microscopy (ESEM)[J]. Journal of Chinese Electron Microscopy Society, 2002, 21(1): 25-29. (in Chinese)
- [12] ATRENS A, WANG Z F. ESEM observations of SCC initiation for 4340 high strength steel in distilled water[J]. Journal of Materials Science, 1998, 33: 405-415.
- [13] 周美玲,谢建新,朱宝泉.材料工程基础[M].北京:北京工业大学出版社,2001.

## *In-situ* Crystal Growth and Chemical Reaction in Wet Environment Scanning Electron Microscopy

JI Yuan, ZHANG Yin-qi, WEI Bin, WANG Li

(Institute of Microstructure and Property of Advanced Materials, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

Abstract: Dynamic observation of dissolving-crystallization process of NaCl crystal and in-situ reaction of BiVO<sub>4</sub> crystal were carried out by using an environmental scanning electron microscope (ESEM) and the micro-manipulator/micro-injector system (MMI/MIS). The step precision of MMI system in three directions, retreat-forward linearity (Z-axis), clock-unclockwise rotation (X-axis) and up-down rotation (Y-axis) are 5, 5 and 0.5 nm, respectively. The size of the liquid droplet of MIS system was about  $200 \,\mu\text{m}-300 \,\mu\text{m}$ . The influences of the water wetting environment on dissolving, growth and growing rate of crystals were studied by changing pressures (450-850 Pa) in chamber and sample temperatures (0-50 °C), as well as by controlling states of water evaporation and condensation. Reactive products of BiVO<sub>4</sub>! octahedron were obtained at 700 Pa and 4 °C via liquid micro-injection approach by using two MMI/MIS systems, i.e., one for NH4VO<sub>3</sub> and one for Bi(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> injection.

Key words: ESEM; dynamic and in-situ; microinjection; wetting; BiVO4 crystal

(责任编辑 郑筱梅)